Title (en)

METHOD FOR PROCESSING SLAG OF A COMBUSTION DEVICE

Title (de)

VERFAHREN ZUM AUFBEREITEN VON SCHLACKE EINER VERBRENNUNGSVORRICHTUNG

Title (fr)

PROCÉDÉ DE PRÉPARATION DE SCORIES D'UN DISPOSITIF DE COMBUSTION

Publication

EP 3252377 A1 20171206 (DE)

Application

EP 17000677 A 20170421

Priority

- DE 102016006368 A 20160530
- DE 102016006416 A 20160531

Abstract (en)

[origin: JP2017215135A] PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method of treating slag of an incineration device to minimize amounts of powder dust particles and fiber of grain components contained in the slag of incineration facilities, even when a CFK material, a GFK material and/or a nano-material is incinerated.SOLUTION: In a method of treating slag of an incineration device, the slag is separated from the incineration device by using a slag removing device, and then sent to a separator to separate fine particles mainly including particles of a diameter of less than 500 μm, from residual slag. A device for executing the method is composed of the slag removing device and the separator, the slag removing device has a slag inlet and a slag outlet, and the separator is divided from the incineration device. The separator is disposed in a closed space having a slag supply port, an air supply port, a fine particle discharge port, and a residual slag discharge port.SELECTED DRAWING: Figure 1

Abstract (de)

Bei einem Verfahren zum Aufbereiten von Schlacke (2) einer Verbrennungsvorrichtung wird die Schlacke mittels einer Entschlackervorrichtung (4) von der Verbrennungsvorrichtung getrennt und anschließend einem Abscheider (5) zugeführt, in dem eine Feinstfraktion von der Restschlacke getrennt wird, die im Wesentlichen Partikel mit einem Durchmesser von weniger als 500 µm aufweist. Eine Vorrichtung zum Durchführen des Verfahrens besteht aus einer Entschlackervorrichtung und einem Abscheider, wobei die Entschlackervorrichtung einen Schlackezugang und einen Schlackeausgang aufweist und den Abscheider von der Verbrennungsvorrichtung trennt. Der Abscheider ist in einem umschlossenen Raum angeordnet, der eine Schlackezuführöffnung, eine Luftzuführöffnung, eine Feinstfraktionsabführöffnung und eine Restschlackeabführöffnung aufweist.

IPC 8 full level

F23J 1/02 (2006.01); **B07B 4/04** (2006.01); **F23J 1/00** (2006.01)

CPC (source: EP)

B03B 9/04 (2013.01); **F23J 1/00** (2013.01); F23J 2217/101 (2013.01); F23J 2900/01001 (2013.01)

Citation (applicant)

- EP 0691160 B1 20010228 - ABB RESEARCH LTD [CH]
- DE 102006035260 A1 20080131 - MARTIN UMWELT & ENERGIETECH [DE]

Citation (search report)

- [XY] EP 2778523 A1 20140917 - HITACHI ZOSEN INOVA AG [CH]
- [XDYI] DE 102006035260 A1 20080131 - MARTIN UMWELT & ENERGIETECH [DE]
- [YA] CH 698068 B1 20090515 - HOCHSCHULE RAPPERSWILINSTITUT [CH]
- [X] DE 102014100725 B3 20141231 - SCHAUENBURG MASCH [DE]
- [X] DE 102011013030 A1 20120906 - BECKMANN ALEXANDRA [DE], et al
- [A] DE 409266 C 19250202 - HARALD ASKEVOLD

Designated contracting state (EPC)

AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)

BA ME

DOCDB simple family (publication)

EP 3252377 A1 20171206; **EP 3252377 B1 20200311**; DK 3252377 T3 20200615; JP 2017215135 A 20171207; PL 3252377 T3 20201019; PT 3252377 T 20200602

DOCDB simple family (application)

EP 17000677 A 20170421; DK 17000677 T 20170421; JP 2017102284 A 20170524; PL 17000677 T 20170421; PT 17000677 T 20170421